

— 実用表面分析セミナー ‘10 —  
ISO 規格を基礎とした表面分析の実際

◆大阪地区プログラム

日時：7月23日（金）10:00—17:00

場所：大阪大学中ノ島センター 2階 講義室1

〒530-0005 大阪市北区中之島4-3-53 TEL: 06-6444-2100

<http://www.onc.osaka-u.ac.jp/>

1. 10:00—10:50  
AES, XPS 分析における空間分解能と分析領域の決定法 (ISO/TR19319)  
井上 雅彦 (摂南大学) ..... 1-1~1-24
2. 10:50—11:40  
XPS と AES の強度軸の繰り返し性と恒常性の評価法 (ISO21270, 24236, 24237)  
— 正しい計測のために —  
荒井 正浩 (住友金属工業株式会社) ..... 2-1~2-26  
  
(昼食：11:40—13:00 各自でお取りください)
3. 13:00—13:50  
XPS と AES の強度軸の直線性の評価法 (ISO21270)  
— 正しい計測のために —  
吉原 一紘 (オキナテクノロジーズジャパン株式会社) ..... 3-1~3-18
4. 13:50—14:40  
オージェ電子分光装置におけるエネルギー軸校正法 (ISO17973, 17974)  
— 元素分析と状態分析のために —  
永富 隆清 (大阪大学) ..... 4-1~4-23  
  
(休憩：14:40—15:00)
5. 15:00—15:50  
AES, XPS における感度係数法による定量 (ISO18118)  
— 定量性を高めるために —  
田沼 繁夫 (独立行政法人 物質・材料研究機構) ..... 5-1~5-30
6. 15:50—16:40  
ISO 規格における代表的な表面分析用語解説 (ISO18115)  
後藤 敬典 (産業技術総合研究所) ..... 6-1~6-10
7. 16:40—17:00  
総合討論

## ◆東京地区プログラム

日時： 7月28日（水）10:00－17:00

場所：NIMS 目黒 データベース棟（51 棟） 302 会議室

〒153-0061 東京都目黒区中目黒 2-2-54 TEL: 03-3719-2727（代表）

[http://www.nims.go.jp/nims/office/tokyo\\_meguro.html](http://www.nims.go.jp/nims/office/tokyo_meguro.html)

### 1. 10:00－10:50

AES, XPS の装置性能パラメータの記述法（ISO15470, 15471）

－ 装置比較のために －

鈴木 峰晴（アルバック・ファイ株式会社） ..... 7-1~7-19

### 2. 10:50－11:40

分析試料の前処理・取付け方法と帯電補償・補正に関する記述方法

（ISO 18116, 19318）

當麻 肇（株式会社 日産アーク） ..... 8-1~8-18

（昼食：11:40－13:00 各自でお取りください）

### 3. 13:00－13:50

XPS のバックグラウンド処理法（ISO/TR18392）

福島 整（独立行政法人物質・材料研究機構） ..... 9-1~9-29

### 4. 13:50－14:40

XPS と AES の強度軸の直線性の評価法（ISO21270）

－ 正しい計測のために －

吉原 一紘（オキナテクノロジーズジャパン株式会社） ..... 3-1~3-18

（休憩：14:40－15:00）

### 5. 15:00－15:50

XPS のエネルギー軸の校正法（ISO15472）

－ 状態分析のために －

橋本 哲（JFE テクノリサーチ株式会社） ..... 10-1~10-19

### 6. 15:50－16:40

AES, XPS における感度係数法による定量（ISO18118）

－ 定量性を高めるために －

田沼 繁夫（独立行政法人物質・材料研究機構） ..... 5-1~5-30

### 7. 16:40－17:00

総合討論